

分析機器部門講習会シリーズ

集束イオンビーム走査電子顕微鏡 (FIB/SEM) 実技講習会のお知らせ

久留米大学の太田啓介先生による集束イオンビームと走査電子顕微鏡を組み合わせたDualBeam装置、Sciosを使用した実技講習会を行います。

日時：平成27年 3月12日(木) 9:30~12:00

講師：久留米大学 医学部 解剖学講座 太田啓介 准教授

使用機器：Scios

受講対象：Sciosを使用予定の方

講習内容：基本操作

場所：医工連携室（研究棟3号館 5階 医工連携室）

定員：約6名

申込期間：平成27年 3月10日（火）12時まで

申込方法：電子メールで、「講習会名（FIB/SEM実技講習会）」「希望日」
「所属講座名」「氏名」「内線番号」「電子メールアドレス」
を明記の上、k.itakura@med.nagoya-u.ac.jp宛にお申込ください。

お問い合わせ先

医学教育研究支援センター 分析機器部門

担当：板倉（内線：5792 Email：k.itakura@med.nagoya-u.ac.jp）

※Webでも講習会情報を掲載しています（<http://www.med.nagoya-u.ac.jp/kiki/workshop/index.html>）